



i线步进式光刻机

NSR-SF155

实现了每小时200片以上的高产出



凭借天钩构造与高速运转的晶圆 工作台实现了高重合精度和高产出

i线步进式光刻机 NSR-SF155

i线步进式光刻机 NSR-SF155 适用于广泛的半导体器件的制造。采用悬吊投影镜头、减轻震动的“天钩构造”。通过高速运转的晶圆工作台，实现了每小时 200 片以上 300 mm 晶圆的高产出。

性能

Resolution	分辨率	≤ 280 nm
NA	NA	0.62
Exposure light source	曝光光源	i-line (365 nm wavelength)
Reduction ratio	缩小倍率	1:4
Maximum exposure field	最大曝光范围	26 mm × 33 mm
Overlay	重合精度	≤ 25 nm
Throughput	产出	≥ 200 wafers/hour (300 mm wafer, 76 shots), 也可用于 200 mm wafer

主要特点

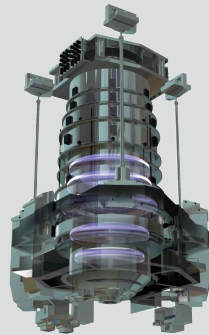
● 超高产出

采用了最适于步进式光刻机的新平台“天钩构造”，同时晶圆工作台可高速运转，从而大幅度降低了振动，并实现了高产出。达到了每小时 200 片以上 300 mm 晶圆的超高产出。

● 高重合精度

采用了“天钩构造”与配重物。并重新配置了空调管路，有利于工作室内的散热。实现了 25 nm 以下的重合精度。

天钩构造



1 级激光产品



安全注意事项

■ 使用前，请仔细阅读“使用说明书”，正确使用本设备。

注 意

本产品及产品技术（包含软件）属于“外汇及外国贸易法”中所规定的管制货物等（包含特定技术）。出口时，请取得政府许可等合法手续。

- 本目录为 2023 年 1 月的产品目录。规格及产品如有变更，恕不另行通知且制造商不承担任何相关责任。
- 本目录刊载的公司名、产品名均为各公司的注册商标或商标。

©2023 NIKON CORPORATION

<https://www.cn.nikon.com/products/semi/>

株式会社尼康

半导体装置事业部 事业企划部

108-6290 日本国东京都港区港南2-15-3

品川城际大厦C 座

电话: +81-3-6433-3639

尼康精机(上海)有限公司

上海市浦东新区平家桥路36号 晶耀前滩 T5 11-12楼,

邮编:200126

电话: +86-21-5899-0266